

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-345351  
 (43)Date of publication of application : 12.12.2000

(51)Int.Cl.

C23C 16/50  
 C23C 16/24  
 H01L 21/205  
 H05H 1/46

(21)Application number : 11-151435  
 (22)Date of filing : 31.05.1999

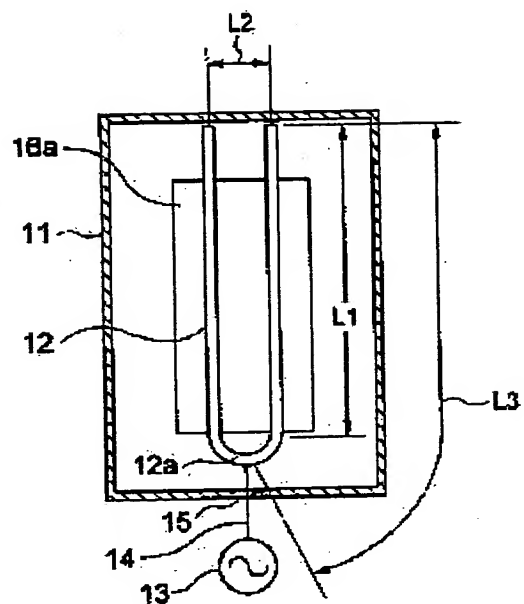
(71)Applicant : ANELVA CORP  
 (72)Inventor : UEDA HITOSHI

## (54) PLASMA CVD DEVICE

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a plasma CVD device in which standing waves are positively utilized in a state of being controllable in an induction coupling type plasma CVD device of an internal electrode system, and the distribution of plasma is satisfactorily controlled and suitable for the formation of a film on a substrate of a large area.

**SOLUTION:** This plasma CVD device is provided with an induction coupling type electrode arranged so as to be confronted with a substrate 16a in a film forming chamber 11. An electrode 12 is formed in such a manner that a linear conductor is folded so as to be involved in the plane with the center point 12a as a standard, and the center point is also constituted as a high-frequency feeding point. By this constitution, desired standing waves are generated, the standing waves are positively utilized, and the distribution of plasma is made better.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2000-345351

(P 2000-345351 A)

(43) 公開日 平成12年12月12日 (2000. 12. 12)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	テーマコード* (参考)
C 2 3 C	16/50	C 2 3 C	D 4K030
	16/24		5F045
H 0 1 L	21/205	H 0 1 L	
H 0 5 H	1/46	H 0 5 H	M

審査請求 未請求 請求項の数 13

O L

(全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平11-151435

(22) 出願日 平成11年5月31日 (1999. 5. 31)

(71) 出願人 000227294

アネルバ株式会社

東京都府中市四谷5丁目8番1号

(72) 発明者 上田 仁

東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネルバ株式会社内

(74) 代理人 100094020

弁理士 田宮 寛社

F.ターム (参考) 4K030 BA30 FA04 KA15 KA30

5F045 AA08 AB04 CA13 CA15 EF03

EF20 EH02 EH04 EH05 EH11

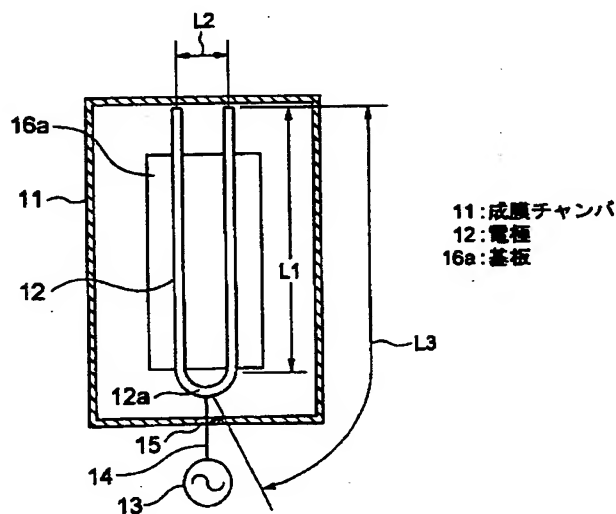
EH19

(54) 【発明の名称】 プラズマCVD装置

## (57) 【要約】

【課題】 内部電極方式で誘導結合型のプラズマCVD装置において定在波を制御可能な状態で積極的に活用し、プラズマの分布を良好に制御し、大面積基板の成膜に適したプラズマCVD装置を提供する。

【解決手段】 このプラズマCVD装置は、成膜チャンバ11内で基板16a、16bに対面して配置された誘導結合型電極を備え、電極12は、線状導体をその中央点12aを基準に平面内に含まれるように折り返して形成され、かつ中央点が高周波給電点として構成される。この構成では、電極において所望の定在波を発生させ、定在波を積極的に活用してプラズマの分布を良好にする。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 反応容器内で基板に対面して配置された誘導結合型電極を備えるプラズマ CVD 装置において、前記電極は、線状導体をその中央点を基準に平面内に含まれるように折り返して形成され、前記中央点を高周波が供給される給電点としたことを特徴とするプラズマ CVD 装置。

【請求項 2】 前記電極は U 字型の形状を有することを特徴とする請求項 1 記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 3】 前記電極は、前記中央点の反対側の箇所 10 で再び折り返され、M 字型の形状を有することを特徴とする請求項 1 記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 4】 前記電極の折り返された単位部分の長さは、前記中央点を基準として、折り返された単位部分で定在波が立つように決められることを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 5】 前記電極の折り返された単位部分の長さは、供給される高周波の周波数に対応して決まることを特徴とする請求項 4 記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 6】 前記電極の端部にインピーダンス要素を 20 設けたことを特徴とする請求項 4 または 5 記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 7】 前記電極における折曲げ部と端部に電磁遮蔽部を設けたことを特徴とする請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 8】 前記電磁遮蔽部は同軸ケーブルの構造であることを特徴とする請求項 7 記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 9】 前記電磁遮蔽部は前記電極のインピーダンス要素として作用することを特徴とする請求項 7 また 30 は 8 記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 10】 前記電磁遮蔽部を利用して前記反応容器内に取り付けることを特徴とする請求項 7～9 のいずれか 1 項に記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 11】 前記電極を、前記基板に対向する平行な面の中に含まれるように複数設け、これらの複数の電極で前記基板の前面空間に同時にプラズマを生成したことを特徴とする請求項 1～9 のいずれか 1 項に記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 12】 前記電極は、前記反応容器内に複数の 40 層構造で配置され、複数層の電極の間の空間を利用して複数の成膜実施領域が作られ、複数の基板を同時に成膜することを特徴とする請求項 1～11 のいずれか 1 項に記載のプラズマ CVD 装置。

【請求項 13】 前記電極は多数の孔を有するパイプ状導体で作られ、かつ材料ガスを供給する手段または排気する手段として用いられることを特徴とする請求項 1～12 のいずれか 1 項に記載のプラズマ CVD 装置。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、内部電極方式で誘導結合型のプラズマ CVD 装置に関し、特に、大面積の基板上に太陽電池や薄膜トランジスタなどに利用されるアモルファスシリコン薄膜を形成するのに適したプラズマ CVD 装置の電極の改良に関する。

【0002】

【従来の技術】内部電極式プラズマ CVD 装置の電極構造には、従来、平行平板型の構造と誘導結合型の構造がある。

【0003】平行平板型の電極によれば、成膜速度の上昇と膜特性の向上のために高周波の周波数を上げようとすると、放電が不均一になるという問題が起きる。この原因は、電極板上に定在波が生じ電力供給が不均一になること、アースへの帰還電流による電圧発生で望ましくない所にプラズマが発生することにある。また大面積の基板を成膜すべく電極板を大型化すると、基板ホルダがアース電極として機能することから基板の裏板が必須となり、かつこの裏板と基板の間の隙間を均一に保つことが難しいという問題を提起する。このため基板の温度分布の均一性を確保することが難しいという問題が起きる。また裏板の取扱いが全般的に難しくなる。このように、平行平板型電極は、大面積基板の成膜には適さない。

【0004】上記の平行平板型電極に対して、誘導結合型電極は、かかる問題が生ぜず、内部電極式プラズマ CVD 装置による大面積基板の成膜に適している。

【0005】面積の大きい大型基板にアモルファスシリコン薄膜を堆積させて太陽電池等を作る従来のプラズマ CVD 装置であって、内部電極方式で誘導結合型のプラズマ CVD 装置としては、例えば特開平 4-236781 号公報に開示された装置が知られている。このプラズマ CVD 装置では、放電用電極は、梯子形態を有する平面形コイルで形成され、基板に対して平行に設置されている。梯子型の平面形コイルは導電性線材で形成されている。材料ガスの導入は反応容器の一箇所に設けた反応ガス導入管で行われ、反応容器内の排気は反応容器の一箇所に設けた排気管で行われている。かかる平面形コイルによって電界の強度を高め、電界の均一性を良好にしている。さらに同様な従来のプラズマ CVD 装置としては、例えば特許第 2785442 号公報に開示される装置を挙げることができる。このプラズマ CVD 装置において、基板に対面して配置される電極には、1 本の導電性線材をジグザグになるように多数回折曲げて形成された平面コイル電極が使用されている。かかる形態を有する電極には、その両端部に、高周波電源からの高周波電圧が印加されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】上記の誘導結合型電極について、梯子形態を有する平面形コイル電極は、電流 50 経路が均一にならず、電極上の場所に応じてインピーダ

ンスが異なり、通電量が異なるので、基板上に付着する膜の量も場所に応じて不均一になり、大面積基板上に均一な膜を成膜できないという問題を提起する。またジグザグ形状の平面形コイル電極は、1本の長い導電性線材を折り曲げて作られており、その一端から高周波を給電するように構成されているので、給電状態が悪く、望ましくない所に定在波が立ち、成膜に支障を生じる。電極上で意図しない定在波が生じ、この定在波がプラズマの分布を不良にし、成膜条件を悪くする。

【0007】本発明の目的は、上記の問題を解決することにより、内部電極方式で誘導結合型のプラズマCVD装置において定在波を制御可能な状態で積極的に活用し、プラズマの分布を良好に制御し、大面積基板の成膜に適したプラズマCVD装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段および作用】本発明に係るプラズマCVD装置は、上記目的を達成するため、次のように構成される。

【0009】本発明に係るプラズマCVD装置は、反応容器内で基板に対面して配置された誘導結合型電極を備える成膜装置であり、上記電極は、線状導体をその中央点を基準に平面内に含まれるように折り返して形成され、かつ中央点が高周波給電点として構成される。この構成では、電極の形態と電極における給電点の位置に基づき、電極において所望の定在波を発生させ、当該定在波を積極的に利用して発生するプラズマの分布を良好にし、良好なプラズマCVD成膜が行われる。給電点を電極における中央点とし、電極の対称性を高めたので、膜の不均一が生じにくい。

【0010】上記の構成において、上記電極は、U字型の形状、あるいは、U字型の電極において、中央点の反対側の箇所まで再び折り返され、全体としてM字型の形状を有するように作られる。電極の中央点である給電点を基準にして、対称的な形状に形成される。

【0011】上記の構成において、上記電極の折り返された単位部分の長さは、中央点を基準として、折り返された単位部分で定在波が立つように決められることを特徴とする。さらに電極の折り返された単位部分の長さは、供給される高周波の周波数に対応して決まることを特徴とする。本発明に係るプラズマCVD装置では、誘導結合型電極を、定在波が生じるアンテナとして積極的に利用するものであり、最適な定在波が生じるように給電される高周波電力との関係で適切な長さに設定される。

【0012】上記の構成において、電極の端部にインピーダンス要素が設けられる。このインピーダンス要素は、電極のインピーダンスを望ましい状態に設定し、所望の定在波を生じせしめる。また電極における折曲げ部と端部に電磁遮蔽部を設けることも可能である。電磁遮蔽部は、電極から生じる電磁界を遮断し、不要な箇所

プラズマが生成されるのを防止する。電磁遮蔽部の具体例としては、絶縁物により被覆された構造や同軸ケーブルの構造である。同軸ケーブルは、電磁遮蔽の作用を生じると共に、構造上強度を有することから、電極の補強部材および支持構造物として利用することができる。同軸ケーブルが支持構造物として利用されるとき、電極は同軸ケーブルの構造によって反応容器に取り付けられる。また電磁遮蔽部は電極の上記インピーダンス要素として作用させることも可能である。

【0013】上記の構成において、電極を、基板に対向する平行な面の中に含まれるように複数設け、これらの複数の電極で前記基板の前面空間に同時にプラズマを生成するように構成される。基板の面積が大きくなる場合には必要な数だけの電極が用意され、設置される。さらに、電極は、反応容器内に複数の層構造で配置することもできる。これによれば、複数層の電極の間の空間を利用して複数の成膜実施領域が作られ、複数の基板を同時に成膜することができる。

【0014】さらに上記電極は多数の孔を有するパイプ状導体で作られ、かつ材料ガスを供給する手段または排気する手段として用いられることを特徴とする。

【0015】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の好適な実施形態を添付図面に基づいて説明する。

【0016】図1と図2を参照して本発明の第1の実施形態を説明する。図1は内部電極式の誘導結合型プラズマCVD装置の内部構造を示す正面図、図2はその側面図を示す。11は成膜チャンバである。成膜チャンバ11において例えば縦置き状態で電極12が配置されている。この電極12に高周波電力が供給され、アンテナとしての機能を有する。電極12は、所要の長さを有する線状導体（導電性線状部材）を、その中央点を基準にして平面内に含まれるように折り返し、正面形状がほぼU字形状となるように形成されている。この例では湾曲した折曲げ部を下側にし、開いた端部を上側にして配置されている。電極を支持する構造の図示は省略されているが、任意の支持構造を採用することができる。線状導体を二つ折りにすることによってU字型電極12が形成され、その半分の長さは、中心点12aと端部の間の長さとして図中L3で示されている。長さL3の部分は、電極12における折り返された部分（折返し部）の長さであり、定在波を生じさせる単位となる部分である。電極12の折返し部の直線部分は好ましくは平行である。電極12では、その中央点12aに対して所要の高周波電力が供給される。高周波電力を供給する高周波電源13は成膜チャンバ11の外側に設けられている。高周波電源13からの給電線14は、成膜チャンバ11に設けられた絶縁部15を経由して成膜チャンバ11の内部に引き込まれ、電極12の中央点である給電点12aに接続され、もって電極12に高周波電力が供給される。上

記電極 12 に対して、その両側に、電極が含まれる平面に平行な状態で基板 16a、16b が配置される。これらの基板は、通常、基板ホルダ（図示せず）によって支持されている。また基板 16a、16b の背面には、通常、ヒータが配置される。なお、この基板ホルダには、平行平板型電極とは異なり、誘導結合型電極であるので、裏板（バックングプレート）は設けられていない。平行平板型電極の場合、基板ホルダには裏板は必要不可欠である。これに対して本発明の電極では裏板は必ずしも必要ではない。ただし基板温度の均一性の向上や、ヒータパネルからの電磁界の遮蔽のための裏板を使用する場合がある。図 1 と図 2 に示すプラズマ CVD 装置では、材料ガス供給機構、排気機構（真空ポンプ）、基板ホルダ、基板加熱機構（ヒータ）、基板冷却機構等の図示が省略されている。

【0017】電極 12 に使用される線状導体は例えば丸棒状で、材質的にはステンレスやアルミが使用される。電極 12 が丸棒状の場合、直径は例えば 5 mm 以上である。図 1 では、二つ折りによって得られる直線部の長さ L1 と、2 つの折返し部の間の長さ L2 の関係について、説明の便宜上長さ L2 が誇張して実際よりも大きく描かれているが、実際上好ましい実施例としては L1 は例えば 75 cm ～ 2.0 m、L2 は例えば約 8 cm である。従って、電極 12 の下側の折曲げ部の湾曲の程度も、実際の電極では、図示される程は大きくはない。図 1 では、電極の折返し部の長さとして、直線部の長さ L1 と、折曲げ部の半分を含めた長さ L3 が示されているが、折曲げ部は直線部の長さに比較してかなり小さいものであるから、長さ L1 と長さ L3 は実際上実質的に同一と考えることができる。長さ L1 については、実際のところ、成膜すべき基板の大きさに応じて決められると共に、定在波を生じせしめるため必要な長さとして設定されるので、供給される高周波の周波数との関係で決められる。例えば周波数が 120 MHz のときには L1 は 1.25 m となる。

【0018】電極 12 の長さ L1（または長さ L3）は、供給される高周波の周波数が  $f$ 、光速を  $c$  とするとき、 $L1 = c / 2f$  で求められる。周波数 120 MHz よりも小さくなると、長さ L1 は 1.25 m よりも大きくなり、成膜チャンバ 11 の内部に設けることができな

い場合も生じる。そこで、このような場合には、後述するように同軸ケーブルの構造を電極 12 の端部に付加して電磁波に関する遅波構造を設けることにより L1 の長さを小さくすることが可能となる。このようにして、前述のごとく L1 は 75 cm ～ 2.00 m の範囲に設定される。L1、L2 の長さは、目的に応じて任意に変更することが可能である。

【0019】成膜チャンバ 11 の内部が真空ポンプによって所要の真空状態に排気され、材料ガス等が導入され、電極 12 に高周波が給電されると、U 字型電極 12

の周囲空間にはプラズマ 17 が生成される。基板 16a、16b にはプラズマ CVD の作用によって成膜が行われる。基板 16a、16b は、実際には、例えば、長辺が 75 cm 程度、短辺が 20 cm 程度の長方形の基板である。U 字型電極 12 には、電極 12 の中央に位置する給電点 12a を基準にして各半部に定在波が生じ、この定在波は、プラズマの分布が良好となるようにプラズマ 17 を制御する。

【0020】上記構成で、電極 12 の折曲げ部は、厳密には湾曲させる必要はなく、鋭角に折曲げたり、角をつけて折り曲げるようにしてもよい。また電極 12 の折返し部の直線部は厳密に平行である必要はない。また上記構成では、電極 12 を縦置きにしたが、電極 12 を水平の横置きにすることもできる。この場合、基板も水平な横置き状態で配置される。

【0021】上記実施形態によれば、誘導結合型の電極を使用するため、容量結合型の電極に比較してプラズマ密度を上昇させやすいという利点を有する。電極の形状を U 字型とし、給電点を電極の中央点とすることにより対称性が高くなり、プラズマの不均一性が生じにくい。

【0022】図 3 を参照して本発明の第 2 の実施形態を説明する。図 3 は、前述の図 1 と同様な図である。図 3 において、図 1 で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。この実施形態では、電極 12 の折曲げ部と端部にカバー 21 を設けて、各部分を被覆するようにしている。カバー 21 は誘電体（絶縁体）で形成されている。電極 12 において、折曲げ部と端部の部分は基板 16a 等の上下の縁の部分に対応するので、カバー 21 を設けることによって当該部分でプラズマが生じるのが防止される。カバー 21 は、必要ないところにプラズマが発生するのを防止する部材である。かかるカバー 21 は電極 12 からの電磁界を遮断する電磁遮蔽部としての機能を有する。電磁遮蔽部としては、上記の構成に限定されず、各種の構成を用いることができる。またカバー 21 は遅波構造として機能させることができる。また電極 21 の変形防止のための補強としても機能する。

【0023】図 4 は、上記電磁遮蔽部の具体的な一例を示す。この例では、同軸ケーブルの構造を利用して電磁遮蔽部を形成している。電極 12 の折曲げ部 12b と 2 箇所の端部 12c において、電極に沿って、誘電体 22 を介在させて金属管体 23 が付設されている。誘電体 22 には例えばアルミナ等が用いられる。かかる同軸ケーブルの構造によって、当該部分でのプラズマ発生を防止することができる。また、かかる同軸ケーブル構造による電磁遮蔽部によれば、インピーダンス要素として作用させることができるので、そのインピーダンスの値を適宜に設定することにより、電極 12 におけるインピーダンスを任意に調整することができ、これによって電極 12 で発生する定在波の分布を自由に設計することができ

る。従って、定在波の積極的活用によって、プラズマの分布状態を望ましい状態に任意に制御することができる。さらに前述のごと同軸ケーブルの構造を遅波構造としても機能させることもできる。

【0024】図5と図6を参照して本発明の第3の実施形態を説明する。図5は図1に対応し、内部電極式の誘導結合型プラズマCVD装置の内部構造を示す正面図、図6はその側面図を示す。これらの図において、前述した実施形態と実質的に同一の要素には同一の符号を付している。この実施形態における特徴は、電極を形成する線状導体の長さをさらに長くし、前述のU字型電極12において2箇所の端部をさらに反対側に湾曲状態で折曲げることにより、全体としてM字型（上下を逆にするとW字型ともいえる）の形態を有する電極31を用いている点である。電極31においてもその中央点31aが給電点となっている。また図6に示すように、電極31は平面に含まれるように折り返されている。電極31では、下側の中央に位置する折曲げ部と、上側の2箇所の折曲げ部によって直線部を含む4箇所の折返し部が形成される。これらの折返し部の直線部は、互いに平行であり、かつ実質的に等しい長さを有するように形成されている。電極31における4箇所の折返し部では、中央点31aから反対側の2箇所の折曲げ部の中央点31b、31cの各々までの長さ、中央点31bから端部31dまでの長さ、中央点31cから端部31eまでの長さが、それぞれ等しくなるように形成されており、これらの長さが、電極31における折返し部の単位の長さとなる。この単位となる長さは、図1で示した長さL3に対応し、この長さに対応するように定在波が発生する。また電極31において、各折返し部の直線部の長さは、図1で示した長さL1に実質的に相当している。また電極31の各折返し部の間の距離は例えば約8cmであり、全体として約24cm程度の幅を有している。電極31はU字型電極12に比較して大型の基板32の成膜が可能となる。なお図1で述べた通り、図5においても、横方向の長さが実際よりも大きくなるように描かれている。實際上、M字型の電極31は、横方向に細幅で縦方向に長い形態を有する。ただし、M字型電極31の幅を広くして作ることも可能である。かかる電極31においても、長さ方向に沿ってその周囲空間にプラズマ17が生成される。電極31の両側に、電極31に平行に基板16a、16bが配置される。その他の構成は、第1実施形態の場合と同一である。

【0025】この実施形態でも、電極31の中央点31aに高周波電力が供給されることを条件に、電極31の折返し部の単位の長さを基準として定在波が立てられる。発生させた定在波でプラズマ17の分布が制御され、最適なプラズマによって基板へのCVD成膜が行われる。特に、中央点31aを中心として電極31が対称な形状に作られ、プラズマの分布を均一なものとするこ

とができる。

【0026】また本実施形態による電極31でも、第2実施形態の場合と同様にプラズマ発生防止のためのカバー21、あるいは電磁遮蔽部を設けることが好ましい。電磁遮蔽部としては前述の同軸ケーブルの構造が好ましい。

【0027】図7は、本発明の第4の実施形態を示す。この実施形態は、図5に示した電極31において、その両端31d、31eの各々と成膜チャンバ11との間にインピーダンス要素33を接続した構成を示している。その他の構成は、第3実施形態と同じである。インピーダンス要素33のZはインピーダンス量を示している。インピーダンス要素33としては例えばコイルやコンデンサが利用される。前述の同軸ケーブル構造による電磁遮蔽部もインピーダンス要素として機能する。このように、電極31の両端の部分に所要のインピーダンス要素33を接続することによって、電極31の全体のインピーダンスを調整でき、電極31の上に立つ定在波（電磁界）を制御することが可能となる。例えば、 $Z = \infty$ にすることにより、電極31における2箇所の先端を電界の節にすることができる。

【0028】図8は、本発明のプラズマCVD装置の構成の変形例を示すものである。この図で、前述した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付している。この構成は、一例として電極41が2つ平行に配置され、各電極41の両側に基板42が平行に配置されている。電極41としては、前述の各実施形態で説明された電極12または電極31等が用いられる。電極41の中央点に対して高周波電源13から高周波電力が供給される。この実施形態によれば、2層の電極構造によって2つの成膜領域を同時に作ることができる。この例では電極41の設置数は2つであったが、同様な多層構造に基づいて電極の数を増すことができ、多領域同時成膜の構成を実現することができる。

【0029】図9は、本発明に係るプラズマCVD装置の変形例で、電極構造をさらに改良したものである。この図で、前述した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付している。この実施形態では、図5で説明した電極をより正確な実際の寸法関係で示し、より大型の基板51を成膜する構成を示している。図9で、31がM字型電極を示し、複数の長方形の破線ブロック52の配列はM字型電極31が並んだ状態を示している。基板51は例えば短辺がほぼ1.2mの長方形の形状を有する角型基板であり、この基板51に対して、長辺が1.2mより大きく、短辺が30cm程度の長方形平面領域（破線ブロック52）に配置されるM字型電極31が複数配置される。M字型電極31は、基板51の大きさに対応するように4つ配置されている。このように大型の基板に対して、本発明に係る電極31は、その面を覆うべく、複数配置される。電極12を用いる場合にも同様



に複数の電極が配列されることになる。

【0030】なお上記の内部電極式の誘導結合型プラズマCVD装置において、材料ガスの導入の仕方については、種々の構成を採用することができる。従来の通り、成膜チャンバ11において通常の1つのガス導入機構および1つのガス排出機構を設けることができる。また本願出願人が先に特願平10-104966号で説明した通り、電極12を例えば外径が10mm程度のパイプ状導電性部材で作って電極53とし、この電極53の例えば直線部の側面に材料ガスを導入する小孔53aをガス吐出口として複数設け、材料ガスを電極内部の通路に導入して複数の小孔から成膜チャンバ内に吹き出すように構成することもできる。この構成では、導入されたガスを即座に引き込んで外部に排気することが必要であることから、例えば、同じ構造を有する排気用の電極54を図10に示すごとく配置で設けるようにする。電極54は、通常の電極として作用する共に、電極53の複数のガス吐出口53aから材料ガスが導入されると、近くのガス吸入口54aからガスを吸入し排気する機能を有している。図10で、矢印55は電極53に供給される材料ガスの流れを示し、矢印56は電極54から排出される材料ガスの流れを示す。

#### 【0031】

【発明の効果】以上の説明で明らかなように本発明によれば、内部電極式の誘導結合型電極を備えたプラズマCVD装置において、電極を、線状導体を折り返して好ましくはU字型あるいはM字型に形成し、電極の中心点に給電を行うように構成し、各折返し部分で定在波が立つように構成し、当該定在波を積極的に活用してプラズマを生成するようにしたため、大面積の基板に対してプラズマCVDにより良好な成膜を行うことができる。特に電極の給電点を中心に対称的な構成としたため、均一なプラズマ分布を作ることができ、成膜を良好に行うことができる。また電極の端部にインピーダンス要素を付設するようにしたため、電極上で生じる定在波を制御することができ、望ましいプラズマ分布を作ることができ、本発明による電極を複数組み合わせることにより、

より大型の基板の成膜にも対応することができる。誘導結合型電極の構造であるため、装置を安価に作製でき、また基板ホルダに裏面が不要な場合は基板のみを加熱・冷却すればよいので、特にEPBT（エネルギー・ペイ・バック・タイム）を問題とする太陽電池の用途では有効である。また電磁遮蔽部を設けるようにしたため、不要なプラズマ生成を防止することができ、最適な電磁界を作ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るプラズマCVD装置の第1実施形態の内部構造を示し、電極の正面図である。

【図2】第1実施形態の内部側面図である。

【図3】本発明の第2実施形態の内部構造を示し、電極の正面図である。

【図4】本発明の電極に付設される電磁遮蔽部の具体例を示す図である。

【図5】本発明の第3実施形態の内部構造を示す内部正面図である。

【図6】第3実施形態の内部側面図である。

【図7】本発明の第4実施形態の内部構造を示す正面図である。

【図8】本発明のプラズマCVD装置の変形例を示す内部側面図である。

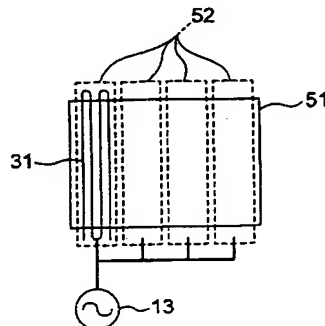
【図9】本発明のプラズマCVD装置の他の変形例を示す正面図である。

【図10】電極の他の構成を示す図である。

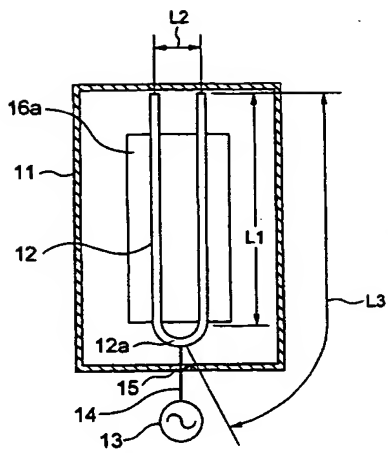
#### 【符号の説明】

11	成膜チャンバ
12	電極
13	高周波電源
16a, 16b	基板
17	プラズマ
21	カバー
22	誘電体
23	金属管体
31, 41	電極
32	基板

【図9】

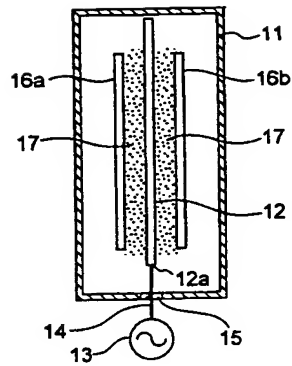


【図 1】



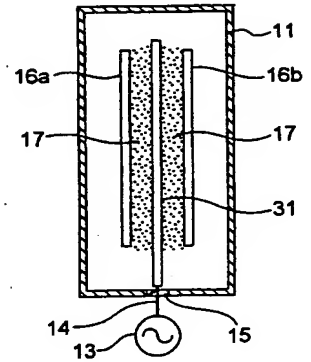
11:成膜チャンバ  
12:電極  
16a:基板

【図 2】

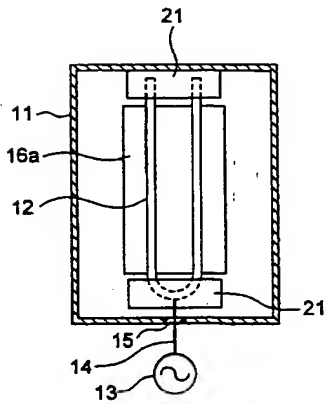


16b:基板  
17:プラズマ

【図 6】

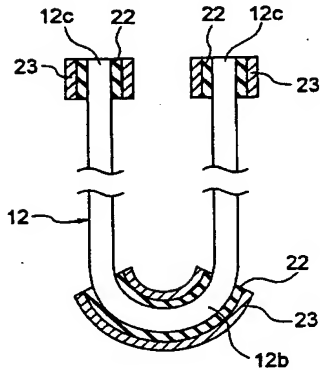


【図 3】



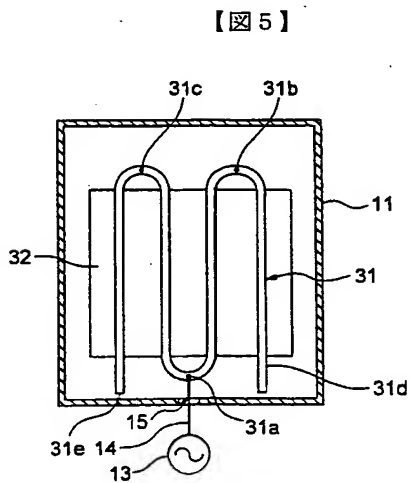
21:カバー

【図 4】

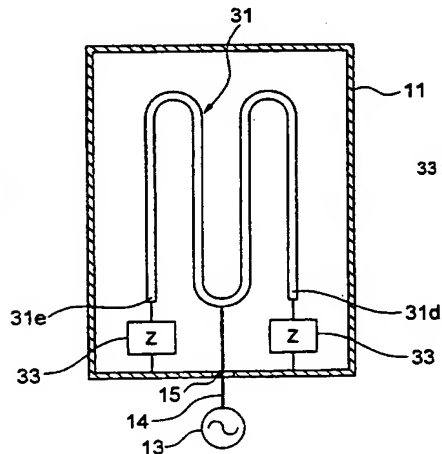


22:誘電体  
23:金属管体

【図 7】



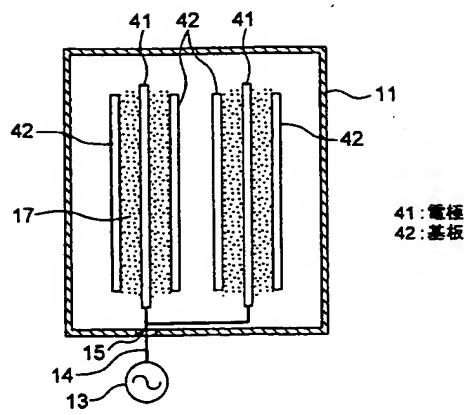
31:電極



33:インピーダンス要素



【図 8】



【図 10】

